# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-232779

(43) Date of publication of application: 21.08.1992

(51)Int.CI.

B41M

G11B 7/00 G11B 7/24

(21)Application number: 02-415581

(71)Applicant : RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

28.12.1990

(72)Inventor: IWASAKI HIROKO

**IDE YUKIO** 

HARIGAI MASATO KAGEYAMA YOSHIYUKI

# (54) INFORMATION RECORDING MEDIUM

## (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an information recording medium in which C/N and erasion ratio is improved, recording and erasion sensitivity is improved, repeating performance of recording and erasion is improved, and the life span is prolonged.

CONSTITUTION: In an information recording medium in which transition between two states takes place utilizing the energy of electromagnetic wave, recording layer thereof is composed of a material shown by the following formula. AgáInâTeãSbó, where 6 á 13, 8 â 17, 18 ã 28, 45 ó 66,  $\hat{a}+\hat{a}+\hat{a}+\phi=100$ .

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2000 Japan Patent Office

### (19) []本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

特開平4-232779

(43)公開日 平成4年(1992)8月21日

技術表示箇		Fi	庁内整理番号	2 <del>9</del>	識別語		(51) int.Cl.
						5/26	B41M
			9195-5D	F		7/00	G11B
			7215-5D	Α		7/24	
x	5/26	B 4 1 M	8305-2H				
・請求 請求項の数3(全 6 頁	密查請求 未請	:					
)出顧人 000006747		71)出顧人		5581	<b>特顯平</b> 2-41	-	(21)出顧番号
-C	株式会社リコ						
区中馬込1丁目3番6号	東京都大田区		2)出顧日 平成2年(1990)12月28日		(22)出顧日		
<u>.</u>	岩崎 博子	72)発明者					
東京都大田区中馬込1丁目3番6号 梯							
·М	会社リコー内						
雄	井手 由紀雄	72)発明者					
	同所						
•	針谷 真人	72)発明者					
	同所						
<u>-</u>	影山 暮之	72)発明者					
	同所						
松 秀岳 (外2名)	弁理士 小松	74)代理人					

## (54) 【発明の名称】 情報記録媒体

(57) 【要約】

【目的】 以下のような改良をした情報記録媒体。

- (1) C/N、消去比の向上、
- (2) 配録、消去感度の向上、
- (3) 配録-消去の繰返し性能の向上、
- (4) 長寿命化、

【構成】 電磁波のエネルギーを利用して記録材料の2 状態間を転移させることにより情報を記録する情報記録 媒体において、記録層が下記の式で表される材料からな る情報記録媒体。

Ag. Ins Ter Sb.

6 ≦ α ≦ 1 3

 $8 \le \beta \le 17$ 

 $18 \le r \le 28$ 

45≦8≦66

 $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 1 \ 0 \ 0$ 

#### 【特許請求の顧用】

【請求項1】 電磁波のエネルギーを利用して記録材料 の2状態間を転移させることにより、情報を記録する情 報記録媒体において、記録層が次の組成式、

Ag. Ins Ter Sb. ただし、

 $6 \le \alpha \le 1.3$ 

 $8 \le \beta \le 1.7$ 

 $18 \le \gamma \le 28$ 45≦∂≦66

 $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 100$ 

により表わされる材料からなることを特徴とする情報配 绿媒体。

【請求項2】 配録材の未記録状態において、記録層中 に結晶質の相と非結晶質の相を含み、そのうち結晶質の 相の記録層の全体に占める割合が50mol%以下であ ることを特徴とする前記請求項1記載の情報記録媒体。

【請求項3】 結晶質の相が主としてAgSbTe,であるこ とを特徴とする前記請求項2記載の情報記録媒体。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光情報配録媒体、特に相 変化型情報記録媒体であって、光ピームを照射すること により記録層材料に相変化を生じさせ、情報の記録、再 生を行い、かつ書換えが可能である光情報記録媒体に関 するものであり、光メモリー関連機器に応用される。

#### [0002]

【従来の技術】電磁波、特にレーザーピームの照射によ る情報の記録、再生及び消去可能な光メモリー媒体の一 つとして、結晶-非晶質相間あるいは結晶-結晶相間の 30 転移を利用する、いわゆる相変化型記録媒体がよく知ら れている。特に光磁気メモリーでは困難な単一ビームに よるオーバーライトが可能であり、ドライブ側の光学系 もより単純であることなどから最近その研究開発が活発 になっている。その代表的な材料例として、USP 3,530, 441 に関示されているようにGeーTe、GeーTeーS 、Geー Se-S, Ge-Se-Sb, Ge-As-Se, In-Te, Se-Te, Se -Asなどのいわゆるカルコゲン系合金材料があげられ る。又、安定性、高速結晶化などの向上を目的にGe-Te 系にAu (特開昭61-219692)、Sn及びAu (特開昭 40 61-270190)、Pd (特開昭62-19490)等を添加した材 料の提案や、記録/消去の繰返し性能向上を目的にGe-Te-Se-Sbの組成比を特定した材料(特開昭62-73438) の提案などもなされている。しかしながら、そのいずれ もが相変化型書換え可能光メモリー媒体として要求され る諸特性のすべてを満足しうるものとはいえない。特に 記録感度、消去感度の向上、オーバーライト時の消しの こりによる消去比低下の防止、並びに記録部、未記録部 の長寿命化が解決すべき最重要課題となっている。

【0003】結晶-非晶質層間相転移や結晶-結晶問相 50 (1) C/N、消去比の向上

転移を利用した相変化形の配録方式においては、入射電 磁波のエネルギーを配録膜内部で熱エネルギーに変換し て記録材料の記録部と非記録部との間の転移を行う、記 録、消去に必要な時間をできるだけ短くするため、例え ば、記録部には準安定相である非晶質相、非記録部には 安定相である結晶相を用いるのが一般的である。準安定 相である非晶質相形成には、分子間の結合を切るため材 料の温度を融点(Ta)以上まで上昇させなければならな い。また、非秩序状態を疎結するための急冷条件が必要 10 である。また安定相である結晶相形成には分子間の結合 を促すため材料の温度を結晶化転移点(Ic)以上まで上 昇させなければならない。また、結晶相形成のための徐 冷条件が必要である。このような原理的な理由から、相 変化型の記録材料には熱履歴による媒体特性や寿命の劣 化が避けられないとされている。記録威度、消去威度、 寿命といった特性は非晶質相と結晶相との間の転移エネ ルギー壁の大きさ、すなわち融点(Tm)と結晶化転移点 (Tc) に大きく影響される。これらのエネルギー壁が小 さいと記録感度、消去感度は良好だが、記録部の寿命が 20 短く、逆に大きいと記録感度、消去感度は劣るが寿命は 長くなる。従って、これらの条件が最も良好となるよ う、一般には融点はおよそ 600℃、結晶化転移点はおよ そ 200℃程度の記録材料が用いられている場合が多い。 感度の向上をはかるため、熱吸収率の大きな材料を記録 膜中に添加したり記録媒体に熱吸収層などを設けている 場合もある。しかしながら、記録材料の温度を融点付近 まで上昇させることは熱履歴による配録消去特性の劣化 の原因となる。さらに半導体レーザーの発振出力を考慮 すると、高紀録パワーを必要とする紀録媒体は記録装置 のコスト高につながる。また、光記録媒体には高速高密 度配録が期待されているが、これらの条件下での配録、 消去は更に高パワーを必要とし、記録・消去感度、C/ N比、消去率の低下の原因となる。

2

【0004】特開昭63-251290では結晶状態が実質的に 三元以上の多元化合物単相からなる配録層を具備した光 記録媒体が提案されている。ここで実質的に三元以上の 多元化合物単相とは三元以上の化学量論組成をもった化 合物(例えばIna SbTex)を記録層中に90原子%以上含む ものとし、このような記録層を用いることにより、高速 記録、高速消去が可能になるとしている。しかし記録、 消去に要するレーザーパワーはいまだ十分に低減されて はいない。また、消去比が低い、繰返し特性、長期の信 頼性が十分ではないこと等の欠点を有している。これら の事情から安定な高感度の記録、消去に適する記録材料 の開発が望まれていた。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記従来技 術に比較して下記の点を改良した情報記録媒体を提供す るものである.

- (2) 記録、消去感度の向上
- (3) 記録-消去の繰返し性能の向上
- (4) 長寿命化

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明の目的は、以上の ような事情に対するものであり、低パワーで安定な記録 消去の繰返しが可能な情報記録媒体を提供するもので ある。そこで本発明者等は改善に鋭意研究を重ねた結 果、前述目的に合致する記録材料を見出した。即ち、本 発明の情報記録媒体の記録層は次の組成式、

Ag. Ins Ter Sb.

ただし、

 $6 \le \alpha \le 13$ 

 $8 \le R \le 1.7$ 

 $18 \le \tau \le 28$ 

45≦8≦66

 $\alpha + \beta + \gamma + \hat{\alpha} = 100$ 

により表わされる材料からなる。さらに、記録材の未記 録状態において、記録層中に結晶質の相と非結晶質の相 を含み、そのうち結晶質の相の記録層全体に占める割合 20 が 50mol%以下である。このような記録材料を用いるこ とによりC/N、消去比は高く、低パワーでの配録、消 去が可能となる。従って記録材料にかかる熱履歴による ストレスを最小限に押さえ、繰返し特性、寿命を大幅に 改善できる。 このような良好な特性を示す記録層の形 成過程、及び配録消去のメカニズムを明らかにするた め、記録媒体のX線回折、電子線回折の測定、透過型電 子園微鏡 (TEN)観察を行った結果、以下のような結果が 得られた。as depo. 状態ではX線回折、電子線回折とも にアモルファス状態であることを示すハローパターンが 30 観察される。また、TEM では非常に均一なアモルファス 相が観察できる。

【0007】レーザーアニールによる結晶化後、すなわ ち未配録部のX線回折には、アモルファス状態の物質の 存在を示すハローパターンとAgSbTex からの結晶性ピー クが観察される。電子線回折パターンには、やはりアモ ルファス状態の物質の存在を示すリング及びハローパタ ーンと、結晶AgSbTezからのスポット回折像が観測され る。このことから、未記録部では結晶AgSbTezとアモル ファス相あるいはそれに近い状態の物質とが両方存在し ている状態であることがわかる。つまり、結晶化の過程 において相分離または分相がおこり、AgSbTez が微結晶 として分散されたことがうかがえる。エレクトロニク・ セラミックスNo.5,(1986) によって示されているよう に、このような過程を通じて形成された分散相は粒径が 数皿~数十皿と小さい。粒径がこのオーダーになると、 サイズ効果により融点は大きく降下する。(図2) AgSb Te2の場合、粒径が 300人になると融点はパルク時の値 の約570℃から約 460℃にまで降下することが予想され る。(表面エネルギーを1000erg/cm²とした場合)。ま 50 法、光CVD法、イオンプレーティング法、電子ビーム

た、界面は結晶粒界であることが特徴であり、このこと が粒径を常に小さく保ち得る要因となっている。実際に X線回折の線幅からシェラーの式を用いてAgSbTe: 結晶 子の平均粒径を求めたところ、AgSbTerは約120点の微結 晶状態であることがわかった。

【0008】また、TENで観察されたグレインの大きさ

は約50A~約300 Aにわたって分布している。X線回折 ではこれらの統計的な平均値が観測されていると考えら れる。以下本発明を添付図面に基づき説明する。図1は 10 本発明の構成例を示すものである。基板(1) 上に耐熱性 保護層(2)、配錄層(3)、耐熱性保護層(4)、反射層 (5) が設けられている。必要に応じて、反射放熱層(5) 上に環境保護層を設けてもよい。耐熱性保護層は必ずし も記録層の両側に設ける必要はなく、耐熱性保護層(2) のみ、あるいは耐熱性保護層(4)のみの構造でもよい。 基板がポリカーポネート樹脂のように耐熱性が低い材料 の場合には耐熱性保護層(2)を設けることが望ましい。 【0009】本発明で用いられる基板は通常ガラス、セ ラミクス、あるいは樹脂であり、樹脂基板が成形性、コ スト等の点で好適である。樹脂の代表例としてはポリカ ーポネート樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリス チレン樹脂、アクリロニトリルースチレン共重合体樹 脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、シリコン 系樹脂、フッ素系樹脂、ABS樹脂、ウレタン樹脂等が あげられるが、加工性、光学特性等の点でポリカーポネ ート樹脂、アクリル系樹脂が好ましい。又、基板の形状 としてはディスク状、カード状あるいはシート状であっ てもよい。

【0010】耐熱性保護層の材料としては、SIO、S 102, ZnO, SnO2, Al2O2, TlO2, In2O 1、MgO、ZrOz等の金属酸化物、SinNi、Al N、TIN、BN、ZrNなどの窒化物、ZnS、In \*S<sub>1</sub>、TaS₄等の硫化物、SIC、TaC、B₄C、W C、TIC、ZrCなどの炭化物やダイヤモンド状カー ポンあるいはそれらの混合物があげられる。これらの材 料は単体で保護層とすることもできるが、お互いの混合 物としてもよい。又、必要に応じて不純物を含んでいて もよい。但し、耐熱性保護層の融点は記録層の融点より も高いことが必要である。このような耐熱性保護層は各 種気相成長法、例えば真空蒸着法、スパッタリング法、 プラズマCVD法、光CVD法、イオンプレーティング 法、電子ピーム蒸着法等によって形成できる。耐熱性保 **護層の膜序としては200~5000Å、好適には 500~3000** Aとするのがよい。 200Aより薄くなると耐熱性保護層 としての機能を果たさなくなり、逆に5000人よりも厚く なると、感度の低下をきたしたり、界面剥離を生じやす くなる。又、必要に応じて保護層を多層化することもで きる。本発明に用いられる記録層は各種気相成長法、例 えば、真空蒸着法、スパッタリング法、プラズマCVD 蒸着法等によって形成できる。気相成長法以外にゾルゲ ル法のような湿式プロセスも適用可能である。記録層の 膜厚としては100~10000A、好適には 200~ 3000Aと するのがよい。

[0011] 反射層としてはA1、Auなどの金属材料 を用いることができるが、必ずしも必要ではない。この ような反射放熱層は各種気相成長法、例えば真空蒸着 法、スパッタリング法、プラズマCVD法、光CVD 法、イオンプレーティング法、電子ピーム蒸着法等によ って形成できる。配録、再生及び消去に用いる電磁波と 10 してはレーザー光、電子線、X線、紫外線、可視光線、 赤外線、マイクロ波等、数種のものが採用可能である が、ドライブに取付ける際、小型でコンパクトな半導体 レーザーが最適である。

#### [0012]

【実施例】以下、実施例によって本発明を具体的に説明 する。ただし、この実施例は本発明をなんら制限するも のではない.

#### [0013] 実施例1

ディスク1としてピッチ 1.6μm 、深さ 700Åの薄付 20 き、厚さ 1.2mm、直径86mmφのポリカーポネート基板上 にrfスパッタリング法により耐熱保護層、記録層、耐 熱保護層、反射層を順次積層し、評価用光ディスクを作 製した。基板上に設ける記録材料としてAgii Inii T C11 S bss を用い、膜厚は1000 A とした。反射層はA L を用い、膜厚 500Aとした。耐熱保護層はSis Naを用い 膜厚は基板側2000A、反射層側1000Aとした。光ディス クの評価は 830nmの半導体レーザー光をNA=0.5 のレン ズを通して媒体面で1μmφのスポット径にしぼり込み基 板側から照射することにより行った。製膜後の記録膜は 30 非晶質であったが、測定に際し最初に媒体面で10mVのD C光でディスク全面を十分に結晶化させ、それを初期 (未記録) 状態とした。ディスクの線速度は7m/secとし た。記録の書き込み条件は、線速度7m/sec、周波数4MIZ とし、オーパーライト時には4MHzと5MHzの信号でオーバ ーライトした。読み取り光パワー(Pr)は1mW とし た。図3に単純記録消去モード時のC/N、及びDC光 による消去後の消去比と、記録レーザーパワー (Pw) との関係を示す。図中、●は記録時のC/N値を示し、 矢印の長さはDC光消去により消去されたC/N値を示 40 す。従って、矢印の先のC/N値が消し残りのC/N値 である。これからわかるように、本発明のディスクでは 非常に高いC/Nが得られる。また、記録されたマーク によるC/N値が 100%消去できる完全消去が実現して いる。さらに、Pw=5mW から記録することができ、Pw= 8mm でC/Nが飽和しはじめることから、高感度な記録 材料であるということができる。最高C/Nとその時の 記録パワー (Pw)、及びDC光による消去後の消去比 を第1表中に示す。図4にオーバーライト時の記録消去 特性を示す。図中、●はパイアスパワー(Pe)5㎜ 時 *50* の組成範囲外ではC/N、消去比は小さくなり、記録パ

のC/Nのピークパワー (Pw) 依存性である。Pwが8m W 以上でC/Nが飽和しはじめ、Pw≥9mW でC/N≥50 dBの高C/Nが得られる。Pw=10mW時における消去比の Pe依存性を図中の○で示す。Pe≥4mf で消去比-40dB 以上の高い値が得られた。特にPe=5ml では完全消去が 達成されている。信頼性に関しては、繰返し性能と保存 寿命について実験を行った。オーバーライトモードの繰 返し試験を行ったところ、105 回以上の繰返し後もC/ N、消去ともに劣化は見られず、高性能を保持すること を確認した。また、70℃、80℃、90℃における耐熱試験 を行ったところ、1500時間後もC/N、消去比に変化は 見られなかった。

#### 【0014】実施例2

ディスク2として基板上に設ける記録材料にAgie In 1. T e 25 S b 51 を用いたものを作製した。ディスクの層 構成などは、ディスク1と同様である。実施例1と同様 の条件下での単純記録消去モード時の最高C/Nとその 時の記録パワー(Pw)、及びDC光による消去後の消 去比を表1中に示す。このディスクにおいてもC/N50 dB以上で完全消去が実現している。

#### 【0015】実施例3

ディスク3として基板上に設ける記録材料にAgaIn 1.4 Te21 Sbe1を用いたものを作製した。ディスクの層 構成などは、ディスク1と同様である。実施例1と同様 の条件下での単純記録消去モード時の最高C/Nとその 時の記録パワー (Pw)、及びDC光による消去後の消 去比を表1中に示す。このディスクにおいてもC/N50 dB以上で完全消去が実現している。

### 【0016】比較例1

比較例として、AgSbTez単相を記録層として用い たディスクを作製した。ディスクの層構成などは実施例 と同様である。実施例と同様の条件下での単純記録消去 モード時のC/N、及びDC光による消去後の消去比と 記録レーザーパワー (Pw) との関係を図5に示す。但 し、初期化パワー、消去レーザーパワー(Pe)は9㎡ とした。図中、口は記録時のC/N値を示し、矢印の長 さはDC光消去により消去されたC/N値を示す。これ より、AgSbTe₂単相のみでは本発明のような完全 消去は実現できず、C/Nも小さくなる。最高C/Nと その時の記録パワー (Pw)、及びDC光による消去後 の消去比を表1中に示す。

## 【0017】比較例2

表1に種々の組成のAg-In-Te-Sb系配録材料 を用いたディスクの単純記録消去モード時の最高C/N とその時の記録パワー(Pw) 及びDC光による消去後 の消去比を示す。測定条件は実施例と同様とする。本発 明の組成範囲でC/N50dB以上、かつ完全消去という良 好な特性を示している。また、記録パワーも12mW以下で あり、非常に高感度な材料であることがわかる。本発明

7

ワーは高くなる。

~ -					
ディスク	組 成	C/N(dB)	消去比(dB)	Pw(m₩)	評価
比較例 2	Agz 4 I 02 5 Te4 1 Sb1 c	32	-5	15	×
比較例 2	Agis In: s Tea s Sb2 7	40	-10	16	Δ
比較例 2	Agis Inie Tear Sbar	45	-25	16	Δ
実施例 2	Ag 1 o I D1 4 Te2 5 Sb5 1	53	-53	12	0
実施例 1	Ag: 1 In: 1 Te2 3 Sb5 5	56	-56	11	0
実施例3	Aga Into Teri Sbar	54	-54	10	0
比較何2	Ag: 1n: Te1 4 Sb1 2	37	-37	13	Δ
比較例 2	Age Ins Ter 1 Sba o	32	-15	14	Δ
比較例 1	Ages Ina Teso Shes	42	-23	10	×

## [0018]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の記録材料 においては、

- (1) C/N、消去比の向上
- (2) 記録、消去感度の向上
- (3) 記録-消去の繰返し性能の向上
- (4) 長寿命化

が達成できた。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の情報記録媒体の構成例を示す断面の模 オ図

【図2】AgSbTc2粒子の粒径と融点との関係を示すグラフ、

【図3】 実施例1の記録媒体の単純記録消去モード時の C/N、およびDC光による消去後の消去比と、記録レーザーパワー (Pw) との関係を示すグラフ、

【図4】オーバーライト時の記録消去特性を示すグラ っ

【図5】比較例1の記録媒体の単純記録消去モード時の C/N、及びDC光による消去後の消去比と、記録レー

20 ザーパワー (Pw) との関係を示すグラフである。

【符号の説明】

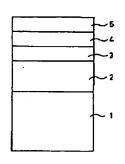
1…基板

2及び4…耐熱保護層

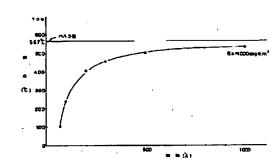
3…記録層

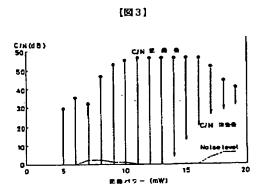
5…反射放熱層

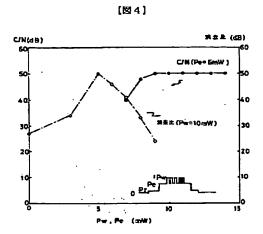
[図1]



[図2]







[図5]

